



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 650/2019

Mitutoyo Česko s.r.o.
se sídlem Dubská 1626, 415 01 Teplice 1, IČ 25458400

pro kalibrační laboratoř č. 2390
Kalibrační laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Kalibrace souřadnicových měřicích strojů (CMM), přístrojů pro měření drsnosti a tvaru povrchu, profilprojektorů, mikroskopů a výškoměrů vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018


Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 380/2018 ze dne 13. 7. 2018, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **3. 12. 2024**

V Praze dne 3. 12. 2019




Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Česko s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Dubská 1626, 415 01 Teplice 1

CMC pro obor měřené veličiny: Délka

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min jedn.	max jedn.					
1*	Souřadnicové měřicí stroje	0 m 0 m	až 5 m až 1,5 m 25 mm		(0,3L + 0,1) μm (0,6L + 0,3) μm 0,2 μm	měření laserovým interferometrem porovnání se stupňovou měrkou porovnání s referenční koulí	MCZ-PI-KL_SDI5_KP 01 (ČSN EN ISO 10360-2, ČSN EN ISO 10360-4, ČSN EN ISO 10360-5)	
2*	Přístroje na měření drsnosti povrchu Ra Rz Rsm Chyba měření linearity Chyba měření přímosti	0,1 μm 0,01 μm 0,1 μm -400 μm -15 μm	až 50 μm až 50 μm až 400 μm až 400 μm 15 μm		3,4 % 2,4 % 0,6 % 4 μm 0,06 μm	porovnání s etalonem drsnosti porovnání s etalonem linearity UDT porovnání s etalonem optické roviny	MCZ-PI-KL_SDI5_KP 02 (ČSN EN ISO 3274, ČSN EN ISO 12179)	
3*	Přístroje na měření profilu povrchu Chyba při měření přímosti	0 mm 0 mm -15 μm	až 200 mm až 60 mm 15 μm	osa X, Y osa Z	(0,3L + 0,2) μm (0,3L + 0,2) μm 0,06 μm	měření laserovým interferometrem porovnání s koncovou měrkou porovnání s etalonem optické roviny	MCZ-PI-KL_SDI5_KP 02 (ČSN EN ISO 3274, ČSN EN ISO 12179)	
4*	Profil projektory Rovnoběžnost P _{XY} Pozice nitkového kříže E _{CH} Chyba zvětšení Měřicí mikroskopy Rovnoběžnost P _{XY}	0 mm -200 μm -200 μm -1 % 0 mm -200 μm	až 200 mm 200 μm 200 μm 1 % 400 mm 200 μm		(8,9L + 1,2) μm 1 μm 4 μm 0,01 % (abs.) (8,9L + 1,2) μm 1 μm	porovnání se skleněným pravítkem	MCZ-PI-KL_SDI5_KP 03	



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Česko s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Dubská 1626, 415 01 Teplice 1

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min	max					
5*	ID měřicí přístroje (výškoměry)	0 m	až 1 m		(0,23L + 0,05) μm	měření laserovým interferometrem	MCZ-PI-KL_SD15_KP 04	
		0 m	až 1 m		(0,5L + 0,3) μm	porovnání se stupňovou měrkou		

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnižší vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Vysvětlivky:

L - délka vyjádřená v metrech

Rovnoběžnost P_{XY} - rovnoběžnost křížového stolu s nitkovým křížem P_{XY}.



Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mitutoyo Česko s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Dubská 1626, 415 01 Teplice 1

CMC pro obor měřené veličiny: Rovinný úhel

Poř. číslo ¹	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) měř. veličiny	Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření ²	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu ³	Pracoviště
		min jedn.	max jedn.					
1*	Přístroje na měření profilu povrchu						MCZ-PI-KL_SD15_KP 02 (ČSN EN ISO 3274, ČSN EN ISO 12179)	
	Chyba měření úhlu v rovině XZ		135 °		0,003 4°	přímé měření úhlové měřky 135 °		
2*	Profil projektory Chyba měření úhlu - otočení matnice o 360°		360 °		0,5'	přímé měření polohy skleněného měřítka	MCZ-PI-KL_SD15_KP 03	

¹ V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

³ U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

